Магнитооптические явления в эпитаксиальных пленках MnAs/CaF₂/Si (111) в поперечном магнитном поле

© А.Г. Банщиков, А.В. Кимель, Б.Б. Кричевцов, А.А. Ржевский, Н.С. Соколов, О.А. Якубцов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

E-mail: kimel@star. shuv.ioffe.rssi.ru

(Поступила в Редакцию 25 июня 1998 г.)

В ферромагнитных эпитаксиальных пленках MnAs, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках CaF₂Si (111), исследованы полевые и угловые зависимости поворота плоскости поляризации при нормальном отражении света ($\lambda = 633$ nm) в поперечном магнитном поле H \perp k. Показано, что поворот плоскости поляризации α определяется четными и нечетными по намагниченности M вкладами. Нечетный вклад связан с отклонением "легкой плоскости" магнитной анизотропии от плоскости пленки, обусловленным разориентацией плоскости поверхности Si от плоскости типа (111) и присутствием небольших областей MnAs с ориентацией (1011). Четный вклад определяется оптической анизотропией пленок, связанной с квадратичными по M добавками в тензор диэлектрической проницаемости ε_{ij} арсенида марганца. Предложена методика разделения этих вкладов, основанная на измерении угловых зависимостей α во вращающемся магнитном поле.

В настоящее время интенсивно исследуются гетероструктуры типа ферромагнетик-полупроводник [1-6]. Интерес к ним связан в первую очередь с возможностью создания гибридных устройств интегральной электроники, оптики и магнитооптики, основанных на сочетании полупроводниковых и магнитных свойств таких систем [1]. Перспективным материалом для создания гетероструктур типа ферромагнетик-полупроводник являются ферромагнитные эпитаксиальные пленки MnAs, выращенные на подложке из полупроводникового кремния Si или арсенида галлия GaAs. Коэрцитивные поля эпитаксиальных структур MnAs/Si (001) и MnAs/GaAs (001) исследовались с помощью вибрационного магнитометра, а также магнитооптическим методом по полевым зависимостям полярного эффекта Керра [2-6]. Следует отметить, что магнитооптические методы широко используются для определения магнитных параметров кристаллов и пленок [7] и имеют определенные преимущества по сравнению с магнитными методами. К ним можно отнести высокую чувствительность, позволяющую исследовать магнитные свойства тонкопленочных структур, состоящих из нескольких монослоев магнитного материала, а также возможность изучения локальных участков пленок. В случае больших коэффициентов поглощения магнитооптические методы могут дать информацию о магнитных свойствах приповерхностных слоев [8,9].

До настоящего времени в пленках MnAs, насколько нам известно, изучался только полярный эффект Керра в продольном магнитном поле. Однако исследования магнитооптических эффектов в поперечных магнитных полях могут дать возможность определения типа магнитной анизотропии и таких параметров, как ориентация "легкой плоскости" или "легкой оси" магнитной анизотропии, величины соответствующих полей анизотропии [7]. Кроме того, такие исследования позволяют определить величину параметров квадратичных по намагниченности М магнитооптических эффектов. Эта информация может быть полезной как для более детального изучения магнитных свойств, структуры эпитаксиальных пленок, процессов их роста, так и для изучения электронной структуры MnAs.

Целью данной работы явилось исследование магнитооптических эффектов при отражении света от эпитаксиальных пленок MnAs на CaF₂/Si (111) в поперечном магнитном поле.

1. Методика

Экспериментальная установка для исследований магнитооптических явлений в пленках MnAsCaF₂/Si (111) представлена на рис. 1. Свет от лазера (Не-Ne, λ = 633 nm, мощность \sim 3 mW) проходил через поляризатор, фарадеевский модулятор поляризации, и падал на образец, находящийся в зазоре электромагнита. Отраженный от кристалла свет проходил в обратном направлении через анализатор и регистрировался фотодиодом. Электрический сигнал измерялся схемой синхронного детектирования. Измерялся поворот плоскости поляризации света, вызванный приложением к образцу поперечного магнитного поля при различных ориентациях образца, магнитного поля и поляризации света. Для этой цели использовалось два типа электромагнитнов. Один из них создавал горизонтальной магнитное поле в диапазоне от -1.5 до 1.5 Т в плоскости образца (**H** \parallel **x**). Образец поворачивался в зазоре магнита вокруг направления **k** в диапазоне азимутальных углов δ от 0 до 360°. С помощью этого магнита изучались полевые зависимости поворота плоскости поляризации. Другой магнит создавал постоянное магнитное поле $H \sim 0.2 \,\mathrm{T} \,(\mathrm{H} \perp \mathrm{k})$ и поворачивался вокруг оси Z в диапазоне азимутальных углов φ от 0 до 360°. Поляризация падающего света *θ* определялась ориентацией поляризатора и изменялась



Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 — лазер, 2 — поляризатор, 3 — модулятор, 4 — магнит, 5 — образец, 6 — анализатор, 7 — фотодиод, XYZ — лабораторная система координат. a — взаимное расположение магнитного поля **H**, поляризация падающего E_{in} и отраженного света \mathbf{E}_r и вектора **a**, характеризующего ориентацию пленки, b — ориентация легкой плоскости магнитной анизотропии и плоскости пленки: **N** — нормаль к плоскости магнитной анизотропии, **n** — нормаль к плоскости пленки.

от 0° до 360°. Как будет показано далее, использование вращающегося магнитного поля дает возможность разделять четные и нечетные по намагниченности эффекты в пленках обладающих спонтанной оптической анизотропией. Схематически взаимная ориентация поляризации падающего света, магнитного поля и азимута образца показана на рис. 1, *а.* Чуствительность измерения поворота плоскости поляризации составляла $\sim 1''$.

Все гетероструктуры MnAs/Si (111) были выращены на установке молекулярно-лучевой эпитаксии. Для получения атомарно-чистой поверхности со сверхструктурой 7×7 подложки Si (111) после стандартной химической обработки загружались в ростовую камеру, где поверхностный слой SiO₂ испарялся путем прогрева в течение 1-2 минут при 1250°С. Для уменьшения рассогласования параметров подложки и пленки между ними выращивался по двухстадийной методике [10] псевдоморфный буферный слой CaF2. Кристалическая структура подложки, эпитаксиальный рост буферного слоя и ферромагнитной пленки контролировались in situ методом дифракции быстрых электронов (ДБЭ) с энергией 15 keV. В картинках ДБЭ для азимутов [110] и [112] наблюдались тяжи, характерные для монокристаллического слоя с поверхностью, гладкой в атомном масштабе. Толщины пленок MnAs измерялись на профилометре. В структурах N 702–743 (табл. 1) арсенид марганца выращивался при 300°С. Для определения совершенства и вида кристаллической структуры исследуемых пленок измерялись кривые рентгеновской дифракции в широком диапазоне углов [11]. С целью предохранения выращенных структур от возможного воздействия атмосферы они покрывались несколькими монослоями CaF₂. Параметры исследованных пленок приведены в табл. 1.

2. Результаты эксперимента

Во всех исследованных образцах, за исключением № 702, приложение магнитного поля в плоскости пленки вызывает поворот плоскости поляризации света, нечетный по магнитному полю. Величина поворота α зависит от азимута образца δ. На рис. 2 показаны полевые зависимости поворота плоскости поляризации для пленки № 703 для трех значений δ . При $\delta = 90$ и 270° зависимости $\alpha(H)$ имеют разный знак и характеризуются сильными изменениями в диапазоне -0.2 < H < 0.2 Т и небольшим уменьшением α в полях |H| > 0.2 Т. При $\delta = 0$ зависимость $\alpha(H)$ практически отсутствует. Ориентационная зависимость скачка $(\alpha(+H) - \alpha(-H))/2|_{H \to 0}$ полученная экстраполяцией из области сильных полей, хорошо описывается зависимостью $\alpha = A \sin \delta$ (см. вставку на рис. 2). Для различных пленок величина А различна и изменялась в пределах от 0 до 55' (табл. 2).

На рис. З представлена ориентационная зависимость $\alpha(\varphi)$, полученная при изменении азимута φ магнитного поля H = 0.2 Т для образца № 703. Зависимость имеет 360° периодичность и описывается комбинацией

Таблица 1. Параметры исследованных пленок

Номер пленки	Разориентация подложки Si (111)	Толщина пленки, пт	Наличие MnAs (1011)
702	2'	750	_
703	4°	400	_
740	9′	190	+
741	9'	180	+
742	7'	130	+
743	7′	190	+

Таблица 2. Параметры A и B, угол разориентации "легкой плоскости" μ и спонтанная оптическая анизотропия исследованных пленок (погрешность определения параметров не более 10%)

Номер пленки	A, sec of arc	<i>B</i> , sec of arc	μ , deg	Спонтанная оптическая анизотропия α_m , sec of arc
702	0	30	0	менее 20
703	55	30	4.0	300
740	25	9	1.1	600
741	27	9	1.8	600
742	32	10	1.1	350
743	28	9	1.3	150



Рис. 2. Полевые зависимости поворота плоскости поляризации α для различных ориентаций пленки 703. На вставке показана угловая зависимость скачка $(\alpha(H) - \alpha(-H))/2\Big|_{H \to 0}$.

гармоник первого и второго порядка по углу φ

$$\alpha(\varphi) = A' \sin(\varphi + \psi) + B \sin(2\varphi + \xi), \qquad (1)$$

где A' и B — параметры; ψ и ξ — фазы первой и второй гармоники, соответственно. Величина A' по модулю совпадает с величиной A, полученной при измерении полевых зависимостей $\alpha(H)$. Следует отметить, что зависимость $\alpha(\varphi)$ существенным образом зависит от ориентации образца δ и поляризации света θ . Тем не менее при любых δ и θ она хорошо описывается формулой (1). Как показал расчет, δ и θ влияют на величину фаз ψ и ξ первой и второй гармоники, в



Рис. 3. Угловая зависимость поворота плоскости поляризации α от азимута магнитного поля φ в пленке 703 для $\delta = 170^{\circ}$, $\theta = 45^{\circ}$. Сплошная линия — расчет по формуле (1), штриховая и пунктирная линии показывают вклады первой и второй гармоник соответственно.

то время как их амплитуды A' и B практически не изменяются.

На рис. 4 представлены угловые зависимости $A'\sin(\varphi + \psi)$ для различных значений δ и θ . Видно, что величина ψ определяется азимутом образца δ и не зависит от азимута поляризации падающего света θ .

На рис. 5 показаны зависимости $B\sin(2\varphi + \xi)$ для различных значений δ и θ . В отличие от ψ величина ξ не зависит от δ , но зависит от θ . Величина $B\sin(2\varphi + \xi)$ достигает максимума, когда угол между поляризацией падающего света и магнитным полем составляет 45°.

3. Обсуждение результатов

Полевые и ориентационные зависимости $\alpha(H, \varphi, \delta, \theta)$, представленные в предыдущем разделе, показывают, что в пленках MnAs/CaF₂/Si (111) поворот плоскости поляризации при нормальном падении определяется четным и нечетным по магнитному полю эффектами. Нечетные по *H* полевые зависимости $\alpha(H)$ (рис. 2) свидетельствуют об индуцировании поперечным магнитным полем (**H** \perp *Z*) проекции намагниченности M_Z на направление распространения света k, которая обусловливает полярный эффект Керра. Величина наводимой полем проекции M_Z зависит от азимута магнитного поля φ . Такое поведение можно объяснить, если учесть магнитную анизотропию пленок. Как известно, монокристаллы MnAs при T = 294 К имеют гексагональную структуру, описываемую пространственной группой D_{6h}^4 . При температурах ниже температуры Кюри $T_c = 315 \, {
m K}$ магнитный момент MnAs ориентирован в плоскости,



Рис. 4. Угловые зависимости $A\sin(\varphi + \psi)$ в пленке 703: $I - \delta = 125^{\circ}, \theta = 45^{\circ}; 2 - \delta = 170^{\circ}, \theta = 45^{\circ}; 3 - \delta = 175^{\circ}, \theta = 25^{\circ}; 4 - \delta = 215^{\circ}, \theta = 45^{\circ}.$



Рис. 5. Угловые зависимости $B \sin(2\varphi + \xi)$ в пленке 703: $I - \delta = 0^{\circ}, \theta = 45^{\circ}; 2 - \delta = 45^{\circ}, \theta = 25^{\circ}; 3 - \delta = 45^{\circ}, \theta = 45^{\circ}.$

перпендикулярной оси 6-го порядка, что соответствует магнитной анизотропии типа "легкая плоскость" [12]. Пленки MnAs/CaF₂/Si (111) также имеют анизотропию типа "легкая плоскость", но по тем или иным причинам нормаль к плоскости пленки **n**, как правило, не совпадает с нормалью к "легкой плоскости" магнитной анизотропии **N**, а составляет с ней некоторый угол μ (соѕ $\mu = \mathbf{Nn}$) (рис. 1, *b*). В этом случае равновесная ориентация намагниченности **M** в магнитном поле **H** определяется минимумом потенциала

$$W = K_a(\mathbf{mN})^2 - \mathbf{MH} + 2\pi(\mathbf{Mn})^2, \qquad (2)$$

где K_a — параметр магнитной анизотропии ($K_a > 0$), **m** — единичный вектор в направлении намагниченности. Намагниченность **M** будет находиться точно в плоскости пленки, если **NH** = 0. В этом случае полярный эффект Керра отсутствует. Если **NH** \neq 0, то намагниченность выходит из плоскости и наибольший отход соответствует максимальному значению NH. Знак угла, характеризующего выход намагниченности из плоскости пленки, определяется знаком поля, т.е. знак проекции M_7 меняется при изменении знака магнитного поля Н. Угловая зависимость полярного эффекта Керра, пропорционального M_z , от азимута магнитного поля φ описывается (для величин полей, больших поля насыщения и много меньших поля анизотропии $H_a \sim 2 \text{ T}$) функцией $A' \sin(\varphi + \psi)$. Величина ψ определяется ориентацией образца, т.е. углом δ , а именно $\psi = -\delta$. При $\varphi = 0$ угловая зависимость полярного эффекта Керра при вращении образца имеет вид $A \sin \delta$, что и наблюдается в эксперименте (см. вставку на рис. 2). Исходя из известных величин полярного эффекта Керра в MnAs [5,6], а также из измерений полярного эффекта Керра в исследованных пленках при М || n, мы получили значения μ в диапазоне от 0–4° (табл. 2).

Если бы поворот плоскости поляризации при нормальном падении определяется только полярным эффектом Керра, то при повороте магнитного поля в плоскости пленки вращательная анизотропия была бы пропорциональной $\sin(\varphi + \psi)$ и не зависела бы от поляризации падающего света. Однако зависимости, представленные на рис. 4, показывают, что это не так. Вращательная анизотропия аппроксимируется функцией (1).

Покажем, что второй член в (1) связан с квадратичным по М поворотом плоскости поляризации. Пусть свет нормально падает на пленку k || n. Ось Z лабораторной системы координат совпадает с нормалью к пленке п. Предположим, что сечение оптической индикатрисы при $\mathbf{M} = \mathbf{0}$ имеет форму окружности, т.е. $\tilde{n}_X = \tilde{n}_Y$, где \tilde{n}_X , *ñ_Y* — комплексные показатели преломления для волн поляризованных вдоль осей Х и Ү. Это предположение справедливо для пленок MnAs типа (0001), поскольку в них оптическая ось перпендикулярна плоскости пленки. Здесь мы пренебрегаем небольшой оптической анизотропией, которая наблюдается в этих пленках в отсутствие магнитного поля и будет рассмотрена далее. Рассмотрим тензор диэлектрической проницаемости в группе D_{6h} при направлении намагниченности М в плоскости пленки вдоль оси Х при учете линейных и квадратичных по намагниченности членов

$$\varepsilon_{ij} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{XX} + aM_X^2 & 0 & 0\\ 0 & \varepsilon_{XX} - aM_X^2 & i\beta M_X\\ 0 & -i\beta M_X & \varepsilon_{ZZ} \end{bmatrix}.$$
 (3)

Все параметры ε_{ij} комплексные. Можно показать, что сечение оптической индикатрисы плоскостью, перпендикулярной **k** (**k** || **z**), в этом случае имеет форму эллипса с одним из главных направлений вдоль вектора намагниченности **M**, т.е. $\tilde{n}_X \neq \tilde{n}_Y$. Тогда матрица отражения света от пленки примет вид [13]

$$R = \begin{bmatrix} 1 + \rho \cos 2\theta & \rho \sin 2\theta \\ \rho \sin 2\theta & 1 - \rho \cos \theta \end{bmatrix},$$
 (4)

где $\rho = (\tilde{n}_X - \tilde{n}_Y)/(\tilde{n}_{XY} - 1); \theta$ — азимут поляризации падающей волны, отсчитываемой от одного из главных

направлений индикатрисы, совпадающего в данном случае с направлением **M**, $\tilde{n}_j = n_j - ik_j$. При $\Delta n \ll n$ и $\Delta k \ll k \ \rho = (\Delta n - i\Delta k)/((n - ik)^2 - 1)$. Выражение для поворота плоскости поляризации α при нормальном падении [14] для случая $|\rho| \ll 1$ и $|\alpha| \ll 1$ имеет вид

$$\alpha = \operatorname{Re}(\rho)\sin 2\theta. \tag{5}$$

Из (6) следует, что учет линейных и квадратичных по **M** членов приводит к повороту плоскости поляризации света, анизотропия которого описывается функцией sin 2θ , причем фаза угловой зависимости эффекта определяется углом между входной поляризацией **E**_{in} и направлением намагниченности **M**. Эффект достигает максимума при $\theta = \pm 45^{\circ}$, как это и наблюдается в эксперименте. Величины Δn и Δk определяются параметрами *a* и β

$$\Delta n \approx \frac{2}{n} \operatorname{Re} \left(2a M_X^2 + \frac{\beta^2 M_X^2}{\varepsilon_{ZZ}} \right), \tag{6}$$

$$\Delta k \approx \frac{2}{n} \operatorname{Im} \left(2a M_X^2 + \frac{\beta^2 M_X^2}{\varepsilon_{ZZ}} \right). \tag{7}$$

Оценки, проведенные при использовании значений *n* и *k* из [15] и величины полярного эффекта Керра при **M** || **k**, показывают, что основной вклад в Δn и Δk определяется членом $2aM_X^2$, а вклад $\beta^2 M_X^2 / \varepsilon_{ZZ}$ на порядок меньше. Величины параметров *A* и *B*, характеризующих нечетный и четный по намагниченности поворот плоскости поляризации в пленках, приведены в табл. 2. Погрешность определения параметров *A* и *B*, а также угла μ составляет ~ 10%.

Таким образом, в эпитаксиальных пленках MnAs/CaF₂/Si (111) в поперечном магнитном поле при нормальном падении света поворот плоскости поляризации α , обусловленной намагниченностью M, связан с полярным эффектом Керра из-за несовпадения плоскости пленки и "легкой плоскости" магнитной анизотропии и с проявлением квадратичных по М членов в тензоре диэлектрической проницаемости ε_{ii} . Несовпадение "легкой плоскости" с плоскостью пленки может быть связано с неточностью ориентации подложки или с несовершенством кристаллической структуры пленок. Как показали результаты рентгеноструктурного анализа, пленки 702 и 703 содержат только MnAs (0001). Угол рассогласования между нормалью к плоскости подложки **n** и осью типа [111] в Si составляет в них $\approx 2'$ и 4° соответственно (табл. 1). Такие же углы образуют в этих пленках и нормали к "легкой плоскости" магнитной анизотропии N по отношению к нормали к пленке **n** (табл. 2). Величина квадратичного по намагниченности поворота плоскости поляризации в этих пленках одинакова. В пленках 740-743 отклонения плоскости поверхности Si от плоскости типа (111) достаточно малы $\approx 6-9'$, но тем не менее в них наблюдаются заметные $\approx 1-2^\circ$ отклонения "легкой плоскости" от плоскости пленки. Это можно связать с присутствием в этих пленках небольших областей MnAs

с ориентацией (1011), которые были зарегистрированы рентгеноструктурными методами. Пусть M₁ обозначает намагниченность областей MnAs (0001), V₁ — удельный объем этих областей, а M₂ и V₂ — намагниченность и объем областей MnAs (10 $\overline{1}1$), причем $|\mathbf{M}_1| = |\mathbf{M}_2|$. В поперечном поле "нормальная" фаза не дает вклада в эффект Керра, так как M₁ находится в плоскости пленки. Фаза типа (1011) может давать вклад поскольку в нем "легкая плоскость" составляет угол 57° с плоскостью пленки и максимальная величина этого вклада пропорциональна $\beta M_2 V_2 \sin 57^\circ$. При измерении эффекта Керра в продольном магнитном поле, когда M_1 , **M**₂ || **n**, поворот плоскости поляризации пропорционален $\beta(M_1V_1 + M_2V_2)$. Легко показать, что в такой простой модели для объяснения величины А в пленках 740-743 достаточно присутствия всего 3% MnAs (1011). Отметим, что углы отклонения "легкой плоскости", приведенные в табл. 2 для пленок № 740-743 в этом случае, следует рассматривать как "эффективные", т.е. полученные в результате усреднения направления М по всей пленке. Величина квадратичного по М поворота плоскости поляризации в пленках № 740-743 одинакова и примерно в 3 раза меньше, чем в пленках № 702–703. Такое различие в величинах квадратичного эффекта может быть связано с разной величиной магнитного момента в пленках № 702-703 и 740-743, что подтверждают измерения магнитного момента пленок и величины полярного эффекта Керра при М || n.

Отклонение ориентации поверхности Si от плоскости типа (111) и присутствие даже небольших количеств MnAs $(10\bar{1}1)$ может проявляться также в существовании оптической анизотропии пленок, которая наблюдается в отсутствии магнитного поля и не связана с магнитным моментом. Величина этой анизотропии определялась путем измерения угловых зависимостей $\alpha(\delta) = \alpha_m \sin 2\delta$ при вращении образца в нулевом магнитном поле. Для различных образцов амплитуда α_m приведена в табл. 2. Наименьшее значение спонтанной оптической анизотропии наблюдалось в пленке № 702, в которой не зарегистрирована дополнительная фаза и величина отклонения плоскости поверхности Si от плоскости типа (111) минимальна. Отметим, что спонтанная оптическая анизотропия, присутствующая в пленках № 703-743, не проявляется при исследовании полевых зависимостей $\alpha(H)$ при использовании фиксированного направления магнитного поля, поскольку в таких измерениях нулевая точка выбирается для любого значения δ при H = 0. В экспериментах, использующих вращающееся магнитное поле, она может проявляться на зависимостях $\alpha(\varphi)$ в виде постоянной, не зависящей от φ , подставки, которая легко исключается учетом постоянного члена в (1). Отметим, что учет спонтанной оптической анизотропии при выводе выражения (8) оказывается несущественным, поскольку приводит к поправкам второго порядка малости.

Следует отметить, что из-за большой величины коэффициента поглощения света пленками MnAs

 $(k \approx 2.2 \ [15])$ магнитооптические явления в отражении света определяются не всем объемом пленки, а только слоем толщиной порядка 20 nm [9]. В принципе, структурные свойства поверхностного слоя, такие, как соотношение между удельными объемами областей MnAs с различной ориентацией, величины напряжений, плотность дислокаций, могут заметно отличаться от свойств объема, что в свою очередь может привести к различию поверхностных и объемных магнитных параметров пленок. В дальнейшем представляется интересным проведение сравнительного анализа магнитных параметров, полученных с помощью объемных магнитных магнитных и магнитооптических методов.

Основным результатом данной работы является определение типа магнитной анизотропии гетероструктур MnAs/CaF₂/Si (111) магнитооптическим методом. Показано, что эпитаксиальные пленки MnAs имеют анизотропию типа "легкая плоскость", которая перпендикулярна направлению [0001] в MnAs. Отклонение "легкой плоскости" от плоскости поверхности пленки связано с отклонением плоскости поверхности Si от плоскости (111) и с присутствием в пленках небольшого количества MnAs с базовой плоскостью (1011). Таким образом, данная методика может быть использована для диагностики гетероструктур типа ферромагнетик-полупроводник. Поскольку глубина сканируемого магнитооптическим методом слоя зависит от длины волны света, спектральные исследования поворота плоскости поляризации при отражении могут дать информацию об изменении магнитных свойств по толщине пленки.

В данной работе обнаружен квадратичный по намагниченности поворот плоскости поляризации при нормальном отражении света от MnAs. Спектральные исследования этого эффекта наряду с полярным эффектом Керра могут быть использованы для получения информации об электронной структуре пленок MnAs.

Авторы благодарят Р.В. Писарева за полезные обсуждения и Н.Ф. Картенко за проведение рентгеноструктурных исследований пленок.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований и программой "Фундаментальная спектроскопия".

Список литературы

- [1] G.A. Prinz. Science **250**, 1092 (1990).
- [2] M. Tanaka. Mater. Sci. Eng. B31, 117 (1995).
- [3] K. Akeura, M. Tanaka, M. Ueku, T. Nashinaga. Appl. Phys. Lett. 67, 3349 (1995).
- [4] K. Akeura, M. Tanaka, T. Nashinaga, J. De Boeck. J. Appl. Phys. 79, 4957 (1996).
- [5] H. Ikekame, Y. Yanase, M. Akita, Y. Morishita, K. Sato. J. Magn. Soc. Jpn. 20, S.1, 153 (1996).
- [6] Y. Morishita, K. Iiida, J. Abe, K. Sato. Cong. Digest 15th Int. Coll. Magnetic Films and Surfaces. Kyoto (August 4–9, 1997).
 P. 154.

- [7] Ф.В. Лисовский, Е.Г. Мансветова, В.И. Шаповалов. Опт. и спектр. 47, 6, 1082 (1979).
- [8] Г.С. Кринчик. Физика магнитных явлений. Изд-во МГУ, М. (1985). С. 321.
- [9] В.Е. Зубов, А.Д. Модестов. Опт. и спектр. 82, 1, 64 (1997).
- [10] N.S. Sokolov, I.C. Alvarez, N.L. Yakovlev. Appl Surf. Sci. 60/61, 421 (1992).
- [11] A.G. Banschikov, M.V. Baydakova, B.P. Zaharchenya, K. Saito, N.S. Sokolov, S.M. Saturin, M. Tanaka. Proc. "Nanostructures: physics and technology". Int. Symp. St. Petersburg, Russia (June 23–27, 1997). P. 288.
- [12] G.E. Bacon, R. Street. Nature 175, 4455, 518 (1955).
- [13] A. Burau, H.-J. Weber, V.V. Pavlov. J. Opt. Soc. Am. A13, 1, 164 (1996).
- [14] Р. Азаам, Н. Башара. Эллипсометрия и поляризованный свет. Мир, М. (1981). С. 583.
- [15] A.M. Stoffel, J. Schneider. J. Appl. Phys. 41, 3, 1405 (1970).